

## 附錄六、揮發性有機物監測設施之規範

(一)規範內容：揮發性有機物監測設施之之安裝規範、性能規格、確認程序、零點及全幅偏移測試程序、相對準確度測試查核程序及校正標準氣體等。

(二)名詞定義

1. 同附錄二、(二)。

2. 多點校正標準氣體：以零點氣體稀釋配製之甲烷標準氣體，配製方法請參照 NIEA A722.71B 七-(二)節(方法之內容或編碼，以環保署最新公告者為準)或以經校正之氣體稀釋器配製之。

(1)低濃度校正氣體：標準氣體濃度為多點校正檢量線的最低點濃度之甲烷。

(2)高濃度校正氣體：標準氣體濃度為多點校正檢量線的最高點濃度之甲烷。

(3)中間濃度校正氣體：標準氣體濃度介於高、低濃度校正標準氣體平均值 $\pm 10\%$ 之甲烷。

(三)安裝規範：監測設施應設置於操作方便且量測污染物濃度、排放速率皆具有代表性之位置。量測位置設定依公告之標準檢驗方法(NIEA A433.71C，方法之內容或編碼，以環保署最新公告者為準)之規定，標準檢驗方法未規定者依下列規定。

1. 量測位置：採樣孔應距污染發生源、控制設備、排放口或任何濃度變化處二倍以上排放管道直徑之長度。若排放口上無適當之採樣孔時，可將採樣管直接由排放口插入二倍直徑或二公尺深處採樣。若採樣孔位於排放管道負壓處，則採樣管與採樣孔之間應完全密封。

2. 數據記錄器：同附錄二、(四)、1。

(四)性能規格：如表 4-1 所示。

(五)監測設施確認程序：同附錄二、(五)

(六)零點及全幅偏移測試程序：同附錄二、(六)。

(七)相對準確度測試查核程序：同附錄二、(七)。

(八)校正標準氣體：同附錄二、(八)。

(九)公式：同附錄二、(九)